

SERVOPRO Plasma (k2001)

Kontrol Analytik
氩气或氦气中的微量氮气
在线气体分析仪

- 等离子发射检测器 *
- 测量量程范围广
- 最低测量量程具有 10ppb 分辨率
- 免维护
- 以太网远程控制



规格

检测器类型:	电磁感应等离子测量池 (双光束)
量程:	0-1ppm: 10ppb 分辨率, 可由用户配置到最高 10000ppm 0-10ppm: 0.1ppm 分辨率, 可由用户配置到最高 10000ppm 0-100ppm: 1ppm 分辨率, 可由用户配置到最高 10000ppm
精确度:	优于满量程的 $\pm 1\%$
响应时间:	在 75ml/min 的流量下阶跃变化 90% 为 20 秒 (通常为 10 秒)
漂移:	$\pm 1\%$ (24 小时) (长期使用时通常为 $\pm 0.5\%$)
建议标定气体:	零点: GP-200 纯化气体 (Getter)
工作温度:	10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
样气流量:	20 至 150ml/min
工作压力:	4 至 20psig
电源:	交流 115V、50-60Hz 或交流 220V、50-60Hz
功耗:	35 瓦 (最大)
重量:	15kg (33lbs)
尺寸 (宽 x 深 x 高):	3U 标准架式安装 482.6mm x 457mm x 133.3mm (19" x 18" x 5.25")

* 正在申请专利

SERVOPRO Plasma (k2001) 设计用于连续测量氩气、氦气或两者混合气中的氦气。其等离子发射检测器可实现精确的测量，并具有很高的稳定性和可靠性。它使用新型微处理器平台，具有超强连接能力，让您能够从世界的任何地方远程控制分析仪。

特点

- 不受干扰的测量系统，基于石英腔内的等离子光谱发射原理
- 固态质量流量控制器
- 低样气流量（可低至 20ml/min）
- 低功耗（35 瓦）
- 无放射源
- 没有移动部件，全静态
- 免维护
- 实时时钟
- 报警历史
- 支持互联网/网络

选配项

- 按照用户定义的时间间隔进行自动零点和自动量程标定
- 2 路报警输出（用户可编程设定点）
- 4-20mA 隔离输出
- 串行端口：RS-232/422/485/调制解调器

应用

- 空分工厂
- 氩气纯化车间
- 低温槽车灌装站
- 特殊气体实验室
- 过程控制
- 钢铁行业
- 化工厂
- 气体管理系统
- 焊接气体控制
- 氦气液化车间